

# 用表面态型半导体可饱和吸收镜实现 Yb:YAG激光器被动调Q锁模

王勇刚<sup>1</sup> 马骁宇<sup>1</sup> 居桂方<sup>2</sup> 张志刚<sup>2</sup>

(1 中国科学院半导体研究所, 北京 100083)

(2 天津大学精密仪器与光电子工程学院超快激光实验室, 天津 300072)

**摘要** 制作了一种新型的半导体可饱和吸收镜——表面态型半导体可饱和吸收镜。用表面态型半导体可饱和吸收镜作为被动锁模吸收体实现了半导体端面泵浦 Yb:YAG 激光器被动调 Q 锁模。在泵浦功率仅有 1.4 W 的情况下, 获得了调 Q 锁模脉冲序列, 锁模平均输出功率 1 mW, 锁模脉冲重复频率 200 MHz。

**关键词** 半导体可饱和吸收镜; 表面态; 调 Q 锁模; Yb:YAG 激光器

**中图分类号** TN248.3<sup>+5</sup>

**文献标识码** A

## 0 引言

1992 年, U. Keller<sup>[1]</sup> 等在腔内引入反共振的法布里-帕罗标准具可饱和吸收体 (antiresonant Fabry-Perot Saturable Absorber, A-FPSA), 实现了 Nd:YLF 自启动的被动锁模, 脉宽 3.3 ps, 但泵浦源为钛宝石激光器。现在, 几乎所有主要的固体激光器和光纤激光器都实现了用半导体可饱和吸收镜进行被动锁模或调 Q<sup>[2-7]</sup>。

本文中, 我们用自己研制的表面态型半导体可饱和吸收镜实现了 Yb:YAG 激光器被动调 Q 锁模, 得到了调 Q 锁模脉冲序列, 锁模平均输出功率 1 mW, 脉冲重复频率 200 MHz。由于我们的泵浦功率已经下降到 1.4 W, 导致入射在半导体可饱和吸收镜上的功率密度太小, 因而没有实现连续锁模。采用表面态型半导体可饱和吸收镜大大降低了非饱和损耗, 这样虽然 Yb:YAG 的激光阈值很高, 我们仍然能够在很小的泵浦功率下就观察到了锁模现象, 进一步的研究还在进行中。

## 1 表面态型半导体可饱和吸收镜基本原理

通常用于 1060 nm 波长附近的半导体可饱和吸收镜采用 GaAs 为衬底, 其上生长由 GaAs 和 AlAs 交替生长构成的半导体布喇格反射镜 (distributed bragg reflector, DBR), 反射率可高达 99% 以上。布喇格反射镜的上面是 In<sub>0.25</sub>Ga<sub>0.75</sub>As/GaAs 量子阱, 其中 In<sub>0.25</sub>Ga<sub>0.75</sub>As 层是采用低温生长或离子注入制备, 目的是产生 AsGa 和 VGa 作为载流子的快速驰

豫的陷阱, 驰豫时间在几皮秒到几十皮秒, 以此来实现被动锁模。In<sub>0.25</sub>Ga<sub>0.75</sub>As 层的另外一个作用是对入射光起非线性吸收作用, 产生光生载流子。但是, 低温生长或离子注入会带来很大的非饱和损耗, 因而会降低脉冲激光输出功率和使用寿命。

基于上述原因, 我们制作了表面态型半导体可饱和吸收镜。与低温型半导体可饱和吸收镜不同之处在于整个材料都采用正常温度生长, 晶体质量很好, 大大减少了非饱和损耗。将吸收区 In<sub>0.25</sub>Ga<sub>0.75</sub>As 紧紧靠在空气表面, 两者之间只有 2 nm 厚的 GaAs 相隔, 使得表面态和体态有相当的重叠, 以保证光入射后吸收区 In<sub>0.25</sub>Ga<sub>0.75</sub>As 产生的载流子能够很快地通过表面向空气中放电而驰豫。

## 2 表面态型半导体可饱和吸收镜制作方法

采用金属有机化学气相沉积 (metal organic chemical vapor deposition, MOCVD) 方法生长表面态型半导体可饱和吸收镜, 如图 1 所示。生长温度为 700 °C, 对用 MOCVD 生长 GaAs 系材料来说为正常温度。DBR 即为布喇格反射镜, 是由 22 对 GaAs/AlAs 组成的, 反射率高达 99% 以上。

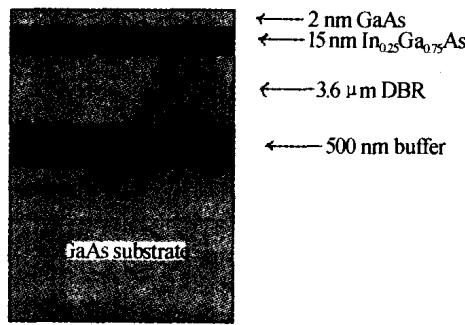


图 1 表面态型半导体可饱和吸收镜生长结构图

Fig. 1 Growth structure of surface type of SESAM

图2为吸收体的光反射谱,垂直轴以相对值表示。可以看到,其带宽约100 nm,高反带从1000 nm到1100 nm。对于皮秒级锁模,反射谱通常只有几个nm就足够了。

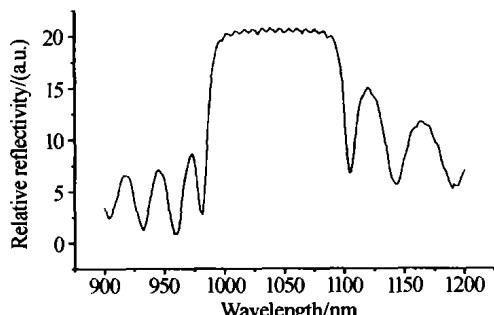


图2 半导体可饱和吸收镜的反射谱

Fig. 2 The reflection spectrum of the SESAM

### 3 表面态型半导体可饱和吸收镜实现Yb:YAG激光器被动调Q锁模实验

本实验采用了X型腔,目的是产生单束脉冲激光输出的同时利用两个泵浦源同时进行泵浦。每只二极管的额定输出功率为1 W(现已分别降至720 mW和680 mW),发射中心波长为942 nm,发射截面为 $100 \mu\text{m} \times 1 \mu\text{m}$ ,光束发散角为 $6^\circ \times 36^\circ$ 。我们获得了1 mW的调Q锁模脉冲激光输出。

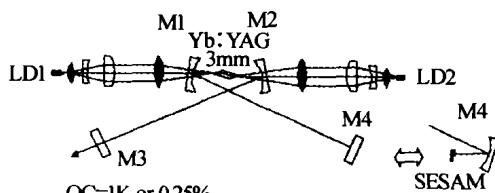


图3 用半导体可饱和吸收镜来实现Yb:YAG激光器被动调Q锁模实验装置

Fig. 3 Experiment setup of modelocking Yb:YAG laser with SESAM

图4为实现的被动调Q锁模调Q包络图,调Q包络的宽度约为8 μs。图5为调Q包络内部选出的部分锁模脉冲,它们的间隔为5 ns,频率为200 MHz。图6为调Q包络的序列图,间隔为180 μs,频率为5.6 KHz。

我们认为,在提高泵浦功率后,一定能够得到连续锁模的脉冲序列。

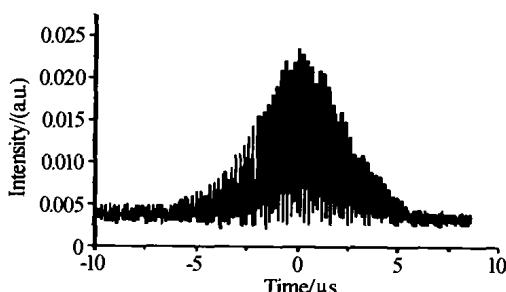


图4 被动调Q锁模调Q包络

Fig. 4 Q-switching envelope of passive Q-switching modelock

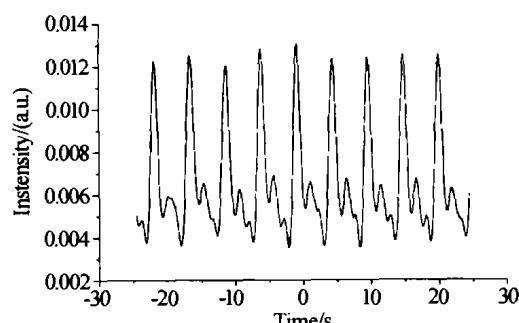


图5 锁模脉冲序列

Fig. 5 Oscilloscope trace of continuous wave modelocking pulse train

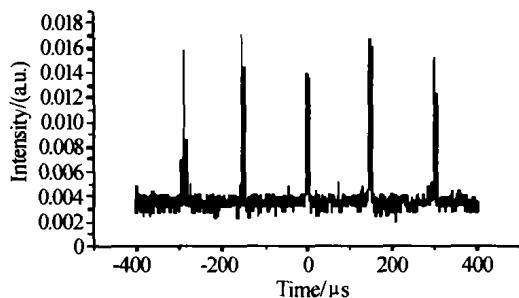


图6 调Q包络序列

Fig. 6 The series of Q-switching envelope

### 4 结论

用MOCVD设备生长了一种表面态类型的新型半导体可饱和吸收镜,它具有优越于国外常见的半导体可饱和吸收镜的性质:非饱和损耗小。用自己研制的表面态型半导体可饱和吸收镜实现了1.4 W端面泵浦Yb:YAG激光器被动调Q锁模,得到了调Q锁模脉冲序列,锁模平均输出功率1 mW,脉冲重复频率200 MHz。我们将提高泵浦功率,做进一步的研究。

### 参考文献

- Tomaru T, Petek H. Femtosecond Cr<sup>4+</sup>:YAG laser with an L-fold cavity operating at a 1.2 GHz repetition rate. *Opt Lett*, 2000, **25**(8): 584~587
- Keller U, Miller D A B, Boyd G D, et al. Solid-state low-loss intracavity saturable absorber for Nd:YLF lasers: an A-FPSA. *Opt Lett*, 1992, **17**(7): 505~508
- Krainer L, Paschotta R, Spühler G J, et al. 29 GHz modelocked miniature Nd:YVO<sub>4</sub> laser. *Electron Lett*, 1999, **35**(14): 1160~1163
- Krainer L, Paschotta R, Moser M, et al. 77 GHz soliton modelocked Nd:YVO<sub>4</sub> laser. *Electron Lett*, 2000, **36**(22): 1846~1849
- 于连君,程光华,王屹山,等.无展宽器的高重复率钛宝石啁啾飞秒脉冲再生放大器的研究.光子学报,2004,33(1):1~3  
Yu L J, Cheng G H, Wang Y S, et al. *Acta Photonica Sinica*, 2004, **33**(1): 1~3

- 6 刘畅. 自缩短效应对 Kerr 被动锁模激光器稳定区的影响. 光子学报, 2004, 33(5): 525 ~ 527  
Liu C. *Acta Photonica Sinica*, 2004, 33(5): 525 ~ 527
- 7 杜晨林, 阮双琛, 于永芹, 等. LD 泵浦 Nd:GdVO<sub>4</sub>/GaAs 被动调 Q 激光器研究. 光子学报, 2004, 33(7): 774 ~ 776  
Du C L, Ruan S C, Yu Y Q, et al. *Acta Photonica Sinica*, 2004, 33(7): 774 ~ 776

## Passive *Q*-switched Modelocking Diode-end-pumped Yb:YAG with Surface-state Type of Semiconductor Saturable Absorption Mirror

Wang Yonggang<sup>1</sup>, Ma Xiaoyu<sup>1</sup>, Ju guifang<sup>2</sup>, Zhang Zhigang<sup>2</sup>

1 Institute of Semiconductors, The Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083

2 Ultrafast Laser Laboratory, School of Precision Instrument and Optoelectronics Engineering, University of TianJin , TianJin 300072

Received date: 2003-11-04

**Abstract** A new type of surface-state semiconductor saturable absorption mirror was introduced, with which passive *Q*-switched modelocking of diode-end-pumped Yb:YAG laser was realized. At the 1.4 W of pumping power, *Q*-switched modelocking seires was obtained, which has 1 mW average output and 200 MHz frequency.

**Keywords** Semiconductor saturable absorption mirror; Surface state; *Q*-switched modelocking; Yb:YAG laser

**Wang Yonggang** was born in 1973. He works in the institute of Semiconductors, the Chinese Academy of Sciences. He majors in absorbers (semiconductor saturable absorption mirrors and GaAs) for the modelocking and *Q*-switching of solid-state lasers.

